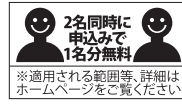


- ★ますます要求が高くなる半導体の高集積化。近づく5nmロジックノード。
- ★半導体の微細化を支えるリソグラフィの基礎、レジスト材料の基礎、要求特性、課題と対策、最新動向
- ★今後の展望、市場動向についても解説。



リソグラフィの基礎、半導体製造における レジスト材料技術と今後の展望

■リソグラフィ、レジスト材料技術のすべて。■



日時	2019年8月26日(月) 10:30~16:30	会場	東京・大田区平和島 東京流通センター 2F 第4会議室
受講料	48,600円 ⇒S&T会員 46,170円 ※S&T会員(郵送DM案内あるいはE-mail案内を希望される方)は価格が5%OFFになります。 (定価: 本体45,000円+税3,600円 会員: 本体42,750円+税3,420円)		資料・昼食付

講師 大阪大学 産業科学研究所 招聘教授 遠藤 政孝 氏
紹介 【元・パナソニック(株)】

趣旨 メモリー、マイクロセッサ等の半導体の高集積化の要求は、携帯端末、情報機器等の高性能化に伴い益々大きくなっており、5nmロジックノードも近づいている。本講演では、これらの半導体の微細化を支えるリソグラフィの基礎、および、レジスト材料の基礎、要求特性、課題と対策、最新の動向を解説し、今後の展望、市場動向についてまとめる。
＜得られる知識、技術＞
リソグラフィ・レジスト材料の基礎知識、レジスト材料の要求特性、レジスト材料の課題と対策、レジスト材料の最新技術・ビジネス動向が得られます。

プログラム	1. リソグラフィの基礎	2.2.3 化学増幅型レジストの安定化技術
	1.1 露光	3. レジスト材料の展開
	1.1.1 コンタクト露光 1.1.2 ステップ&リピート露光	3.1 液浸リソグラフィ
	1.1.3 スキャン露光	3.2 ダブル/マルチパターンニング
	1.2 照明方法	3.2.1 リゾーエッチ(LE)プロセス
	1.2.1 斜入射(輪帯)照明	3.2.2 セルフアラインド(SA)プロセス
	1.3 マスク	3.3 EUVリソグラフィ
	1.3.1 位相シフトマスク 1.3.2 光近接効果補正(OPC)	3.3.1 分子レジスト 3.3.2 ネガレジスト
	1.3.3 マスクエラーファクター(MEF)	3.3.3 ポリマーバウンド酸発生剤を用いる化学増幅型レジスト
	1.4 レジストプロセス	3.3.4 無機/メタルレジスト
	1.4.1 反射防止プロセス 1.4.2 ハードマスクプロセス	3.4 自己組織化(DSA)リソグラフィ
	1.4.3 化学機械研磨(CMP)技術	3.4.1 グラフォエピタキシー 3.4.2 ケミカルエピタキシー
	1.5 ロードマップ	3.4.3 高χ(カイ)ブロックコポリマー
	2. レジスト材料の基礎	3.5 ナノインプリントリソグラフィ
	2.1 溶解阻害型レジスト	3.5.1 加圧方式 3.5.2 光硬化式
	2.1.1 g線レジスト 2.1.2 i線レジスト	4. レジスト材料の技術展望、市場動向
	2.2 化学増幅型レジスト	
	2.2.1 KrFレジスト 2.2.2 ArFレジスト	

□質疑応答・名刺交換□

■2名同時申込みで1名分無料■
(1名あたり定価半額の24,300円)

※2名様ともS&T会員登録をいただいた場合に限りです。 ※他の割引は併用できません。
※同一法人内(グループ会社でも可)による2名同時申込みのみ適用いたします。
※3名様以上のお申込みの場合、左記1名あたりの金額で受講できます。
※受講券、請求書は、代表者にご郵送いたします。
※請求書および領収書は1名様ごとに発行可能です。(通信欄に「請求書1名ごと発行」と記入ください。)

※講師、プログラムの内容が変更になる場合もございます。最新の情報はHPにてご確認ください。 ※申込用紙が複数枚必要な場合等は、本用紙をコピーしてお使いください。

セミナー申込用紙 A190836 (リソグラフィ・レジスト)

会社名 団体名		
部署		
役職	〒	
ふりがな	住所	
氏名		
TEL	FAX	
E-mail	※申込みに関する連絡に使用するため、可能な限りご記入ください。	

※太枠の中をご記入下さい。 ※□にチェックをご記入ください。
※E-mailアドレスまたはFAX番号を必ずご記入下さい。

今後のご案内	
<input type="checkbox"/> E-mail希望・登録済み	S&T会員価格を 適用いたします。 (E-mailアドレス必須)
<input type="checkbox"/> 郵送希望・登録済み	
<input type="checkbox"/> 希望しない	
お支払方法	
<input type="checkbox"/> 銀行振込(振込予定日 月 日)	
<input type="checkbox"/> 当日現金払い	
通信欄	

●受講料について
「2名同時申込みで1名分無料」については上記の注意事項をお読みください。
●お申込みについて
申込用紙に必要事項をご記入のうえ、FAXでお申込みください。
また、当社ホームページからでもお申込みいただけます。
お申込みを確認次第、請求書・受講券・会場案内図をお送りします。
●お支払いについて
受講料は、銀行振込(原則として開催日まで)、もしくは当日現金にてお支払いください。
銀行振込の場合、原則として領収書の発行はいたしません。
振込手数料はお客様が負担ください。

●個人情報の取り扱いについて
ご記入いただいた個人情報は、事務連絡・発送の他、情報案内等に使用いたします。
詳しくはホームページをご覧ください。
●キャンセル規定
開催日から逆算(営業日:土日・祝祭日等を除く)いたしまして、
・開催7日前以前のキャンセル: キャンセル料はいただきません。
・開催3~6日前でのキャンセル: 受講料の70%
・開催当日~2日前でのキャンセル・欠席: 受講料の100%
※ご注意※ 参加者が最少催行人数に達しない場合など、事情により中止になる場合がございます。

S&T サイエンス & テクノロジー
研究・技術・事業開発のためのセミナー/書籍
サイエンス&テクノロジー株式会社
TEL 03-5733-4188 FAX 03-5733-4187
〒105-0013
東京都港区浜松町1-2-12 浜松町F-1ビル7F
http://www.science-t.com